

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

2026 **2/19** Thu. 15:00~16:00

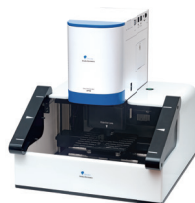
光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ

光干渉式の膜厚計について、測定がうまくいかない、干渉が見えていないのに膜厚がうまく出ない、そもそも測定がうまくいっているかわからない、ということはありませんでしょうか？

光干渉法の原理から測定例、よくある測定の質問、測定のコツなど光干渉法を原理とする膜厚測定装置をより良く使っていただく情報をご紹介します。

* 本セミナーは2025年6月に放映したものを配信いたします。

関連機器



顕微分光膜厚計
OPTM series

顕微分光を用いた微小領域での
絶対反射率測定により、高精度な膜厚・
光学定数解析が可能な装置

お申込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/530>

ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：岡本・真木

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp